

触媒および熱方式のアフターバーニングシステム,排ガス洗浄装置



特に脱バインダー処理における排気ガス浄化に関して、ナーバー・サームはプロセスに適合した排ガス浄化システムを提供しています。アフターバーニング装置は炉の排ガスフィッティングに確実に接続され、炉の制御および安全スキームに相応して稼働します。既存の炉に対しては、炉のタイプに依存せず独立に制御・運転できる排ガスシステムを提供します。

触媒方式アフターバーニング KNV

大気中の脱バインダープロセスで発生する炭化水素だけを浄化することが求められる場合は、エネルギー観点から触媒方式の排気浄化システムが適しています。排ガス量が少量から中量向きです。

- 大気中の脱バインダープロセスで発生する排ガス中に有機物だけが含まれる場合に最適
- 排ガスを二酸化炭素と水の中で分解
- コンパクトなステンレスケーシングに組み込まれた浄化システム

触媒 KAT 50 を装備した標準型マッフル炉 L 5/11 は14ページを参照

- 排ガスを触媒方式浄化に最適な反応温度にする電気予備加熱
- 設備の異なる位置に配備された触媒フィルターによる浄化
- 処理ガス、触媒フィルターおよび排ガスの温度を計測する熱電対
- 触媒装置を防護するために手動設定可能な過昇温計
- 脱バインダー炉の排気フィッティングや排ガスファンに対応した安全技術をシステム全体に結合
- 排ガス量に応じて触媒サイズを設定
- 浄化ガス計測 (FID) 用のフィッティングは



触媒方式アフターバーニングを備えたチャンバー炉 NA 500/65 DB200

熱方式アフターバーニングシステム TNV

脱バインダープロセスで発生する大量の排気浄化が求められる場合、あるいは排ガスが触媒装置を損傷する可能性がある場合は、熱方式のアフターバーニングシステムが適用されます。不燃性および可燃性の保護ガス反応ガス雰囲気下での脱バインダーでもアフターバーニングが行われます。

- 大気下の脱バインダー処理で、大量の排ガスや短期間に排気ガスが噴出流出する場合、あるいは不燃性または可燃性の保護ガス反応ガス雰囲気下での脱バインダーに最適
- 排ガス燃焼のためのガス加熱
- 排ガスを最高 850 °C で燃焼する熱分解方式
- 自動燃焼機構を装備したコンパクトなバーナーによる加熱
- 燃焼室および未処理ガス流入口に熱電対を配備
- 熱方式アフターバーニングを防護する手動設定可能な過昇温計
- 排ガス量に対応した設計
- 浄化ガス計測 (FID) 用のフィッティングは

排ガス洗浄装置

排ガスフレア装置または熱方式のアフターバーニング装置で発生した排ガスがうまく処理されない場合、排ガス洗浄装置がよく使用されます。余分な排ガスの構成要素は、洗浄装置のコンタクトゾーン内で洗浄液を通して排出されます。洗浄装置は、洗浄液の選択や液体の性質、コンタクトゾーンによって各々のプロセスに最適化され、ガスや液体、または固体の構成要素が、排ガスからしっかり洗浄されます。



熱方式アフターバーニングの図解 (TNV)